

BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 10-097962

(43)Date of publication of application : 14.04.1998

(51)Int.Cl.

H01L 21/02
F24F 7/06
H01L 21/22
H01L 21/31

(21)Application number : 08-269213

(71)Applicant : TOKYO ELECTRON LTD

(22)Date of filing : 19.09.1996

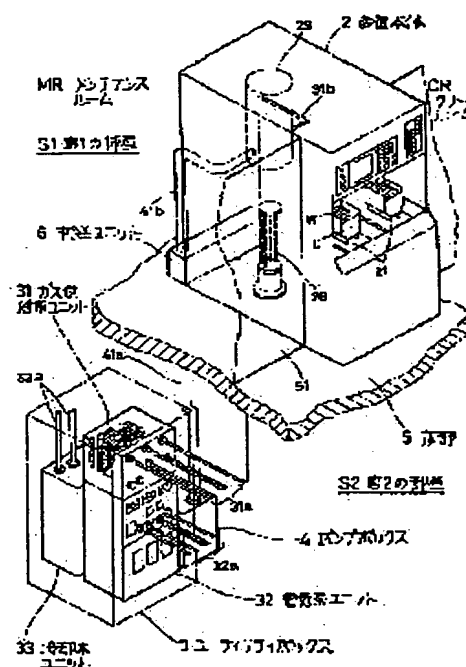
(72)Inventor : MIYASHITA MASAHIRO

(54) TREATING DEVICE AND TREATING SYSTEM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To effectively utilize a highly clean first chamber and, at the same time, to easily connect utility lines on the main body side of a treating device to the utility lines of utility facilities.

SOLUTION: The main body 2 of a treating device is set in a highly clean first chamber S1 and utility facilities (a utility box 3 and a pump box 4) are set in a second chamber S2 provided below the chamber S1. A relaying unit 6 is provided on a floor section 5 dividing the chambers S1 and S2 from each other so that the air in the second chamber S2 cannot flow in the first chamber S1 and utility lines on the first chamber S1 (device main body 2) side and utility lines on the second chamber S2 (utility facility) side are connected to the unit 6 in disconnectable states.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.11.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

特開平10-97962

(43) 公開日 平成10年(1998) 4月14日

(51) Int. Cl. ⁶	識別記号	F I	
H01L 21/02		H01L 21/02	D
F24F 7/06		F24F 7/06	C
H01L 21/22	511	H01L 21/22	511 Q
21/31		21/31	E
審査請求 未請求 請求項の数 5 F D (全 8 頁)			

(21) 出願番号 特願平8-269213
(22) 出願日 平成 8 年(1996) 9月19日

(71) 出願人 000219967
東京エレクトロン株式会社
東京都港区赤坂 5 丁目 3 番 6 号
(72) 発明者 宮下 正弘
神奈川県津久井郡城山町町屋 1 丁目 2 番 41
号 東京エレクトロン東北株式会社相模事
業所内
(74) 代理人 弁理士 井上 俊夫

(54) 【発明の名称】 処理装置及び処理システム

(57) 【要約】

【課題】 クリーン度の高い第 1 の部屋の有効利用を図ること。また処理装置本体側の用力ラインと用力設備の用力ラインとの接続を容易にすること。

【解決手段】 クリーン度の高い第 1 の部屋 S 1 に装置本体 2 を設け、当該部屋の下部に設けられた第 2 の部屋 S 2 に用力設備 (ユーティリティボックス 3 及びポンプボックス 4) を設ける。第 1 の部屋 S 1 と第 2 の部屋 S 2 とを区画する床部 5 に中継ユニット 6 を第 2 の部屋 S 2 の空気が第 1 の部屋 S 1 に流れ込まないように設け、第 1 の部屋 S 1 側 (装置本体 2 側) の用力ラインと第 2 の部屋 S 2 側 (用力設備側) の用力ラインとを中継ユニット 6 に対して着脱自在に接続する。

